

## 宇部高専主要設備・機器

電気・制御系

機器名：低温磁気抵抗測定システム

メーカー：ハヤマ

形式：MRLT-104K



仕様

- ・電磁石：発生磁界最大 1T
- ・DC 電流源：設定分解能 100fA、出力 11W
- ・DC 電圧計：測定分解能 1nV
- ・スキャナ・マトリックス
- ・温度制御：約 10K～室温

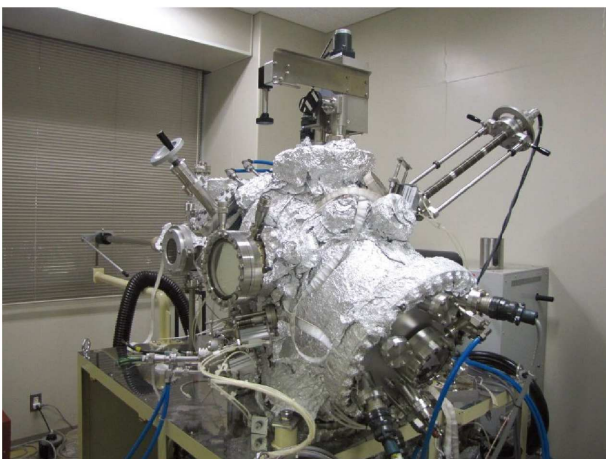
用途・特徴

磁場中にて試料の電気的特性を調べる装置です。4端子測定を基本とする測定に関して拡張性が高く、目的に応じて測定系を組み替えることが可能です。真空中、極低温の環境下での測定が可能です。

機器名：分子線エピタキシー装置

メーカー：日本真空技術

形式：MBC-2000-2C



仕様

- ・ベース真空： $\sim 5 \times 10^{-8} \text{Pa}$
- ・使用基板サイズ：最大 2 インチ  $\phi$
- ・基板加熱温度：最高 1000°C
- ・分子線蒸着源：4 基（内高温型 1 黄）
- ・電子ビーム蒸着源：1 基

用途・特徴

固体原料をソースとした分子線エピタキシー装置であり、超高真空中にて単結晶薄膜を作製することができます。成長過程を反射型高速電子回折により調べることが可能です。